



فصل چهارم - آشنایی با فریده ای از اصول عملده سنسورها و سیستم های اندازه گیری

روش مطالب : سنسورهای مداریمی

سنسورهای خارجی

سنسورهای داخلی

اثرات نیروالکترونیک

روش کنترل

فرمیدوسرها : تجهیزات الکترونیکی حساسندندید تغییر مکانی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل میکنند

کریس از آماده سازی و پلاش ، به صورت ولتاژ قابل نمایش است .

در این فصل ، هدف ، معرفی بنای فریده ای که بر فریده ای از سنسورهای مورد استفاده در حوزه

خود می باشد

الف) اندازه گیری جایابی (Position Sensors) :

از جمله متداول ترین و مورد استفاده ترین نسبت مورد اندازه گیری در سیستم های مکانیکی ، جابجایی می باشد . (کاربرد در سیستم های کنترل

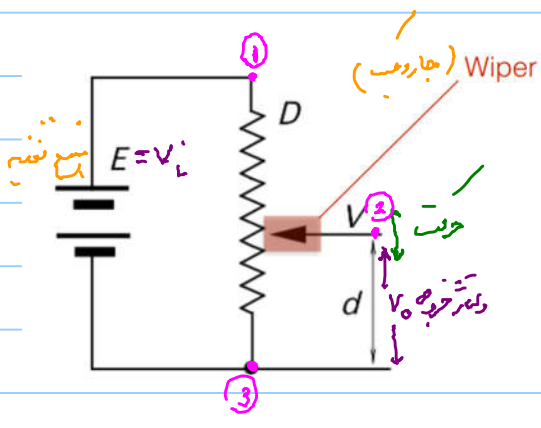
موقعیت ، پهنای و ...) ؛ اندازه گیری جابجایی می تواند به صورت مطلق یا نسبی صورت گیرد .

از جمله سنسورهای جایابی می توان به **مانسومترهای خطی (دردنی)**، **سنسورهای چرخشی**، **رسانسورهای ناهمبندی (المانی)**،

سنسورهای انتراسونیک (امواج ماونوسونیک)، **سنسورهای مادون قرمز** (امواج الکترومغناطیسی)، **انفودرها** و ... اشاره کرد.

به سنسورهای جایابی معمولا خطی از رسم های تک بعدی سرچشمه (مثال: کاربرد در شتاب سنج بودن) و نظریه های سطحی (مثال: بودن)

الف - ۱) **مانسومترها**



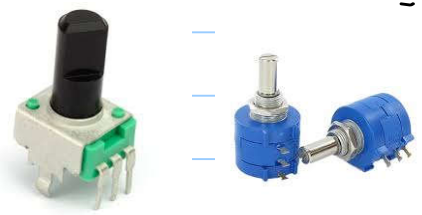
مانسومترها، سنسورهای **مقاومی** هستند که جهت اندازه گیری **موقعیت** مطلق

خطی یا **دردنی** استفاده می شوند.

فرمول حالت برسنسورهای **مقاومی** را اینست $R = \rho \frac{l}{A}$ باشد

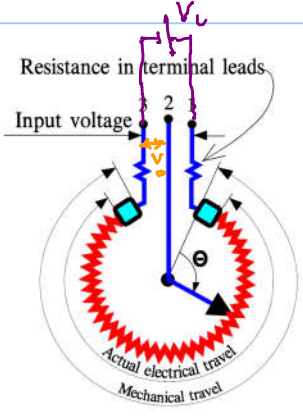
$$V_o = \frac{x}{L} V_i \Rightarrow x = \frac{V_o}{V_i} L$$

از آنجا که **طول** توانسیم، **مقاومت** نمی دارد، **توان** بالا می رود و **برسوخ** درودی ممکن می آید (بزرگ RI^2 به بزرگ $I \Rightarrow R$ کوچک)



از این رو به جای **سیم مستقیم** از **سیم پیچ** استفاده می شود.

به **مانسومتر**، معمولا یک **عنصر سه پایه** (پایه های ۱، ۲ و ۳ در تصویر کاربرد است) می باشد و از هر دو **سنسورهای فعال** می باشد.



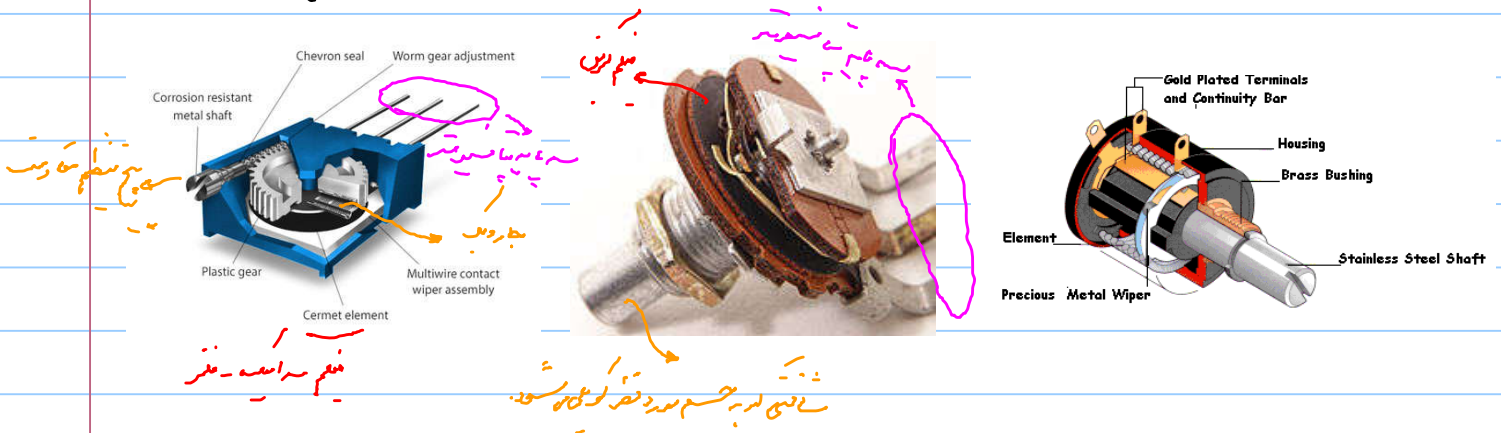
اندازه گیری **موقعیت** **دردنی** (کاربرد: تنظیم **صدای** رادیو، **دسته های بازی** کامپیوتری، ...):

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{\theta}{\theta_{max}} \Rightarrow \theta = \frac{V_o}{V_i} \theta_{max}$$

به منظور آرایش زرد روشن، سنسورهای دورانی می‌توانند به جای حلقه تماسی، از **مطم‌های ثابت** (به عنوان شکل به تصویرهای) استفاده کنند.

مطم‌های ثابت، مطم‌های و یا برقی (مطم‌های) ساخته می‌شوند که **هفتی** و **نیز** عمر طولانی‌تری دارند.

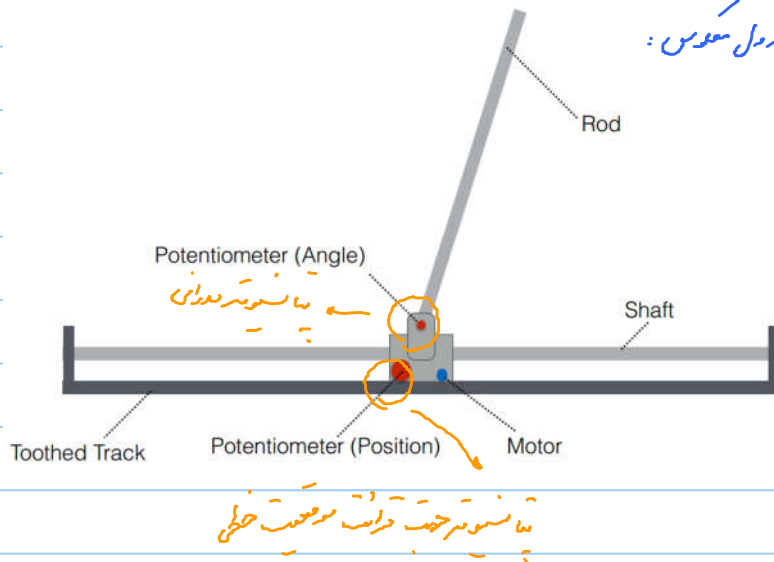
مطم‌های اندازه‌گیری سنسورهای جایگزین دورانی را می‌توان با استفاده از یکی از راه‌های زیر، همچون **فرد**، **مطم‌های** و **مطم‌های**، آرایش داد.



از مزایای سنسورهای دورانی، **اندازه** و **استفاده** و از **مطم‌های** آن‌ها، **مطم‌های** اندازه‌گیری **مطم‌های** و **مطم‌های** است.

مزایای این سنسورها، **اندازه** و **استفاده** و از **مطم‌های** آن‌ها، **مطم‌های** اندازه‌گیری **مطم‌های** و **مطم‌های** است.

شکل: **اندازه** و **استفاده** و از **مطم‌های** آن‌ها، **مطم‌های** اندازه‌گیری **مطم‌های** و **مطم‌های** است.



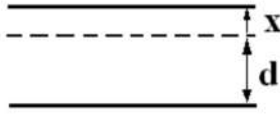
2- **سنسورهای خازنی (Capacitive Sensors)**

مطم‌های سنسورهای خازنی بر اساس **مطم‌های** و **مطم‌های** است. **مطم‌های** و **مطم‌های** با **مطم‌های** و **مطم‌های** است.

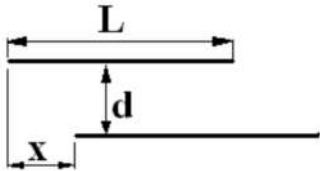
به **مطم‌های** و **مطم‌های** است. **مطم‌های** و **مطم‌های** با **مطم‌های** و **مطم‌های** است.

$C = \frac{K \epsilon_0 A}{d}$ ثابت دی الکتریک ضریب انقباضی خطی = $8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$

1) سنسورهای با چند سوسور سطحی خارج



$$C = \frac{K \epsilon_0 A}{d+x} \rightarrow \frac{C_1}{C_2} = \frac{d+x_2}{d+x_1}$$



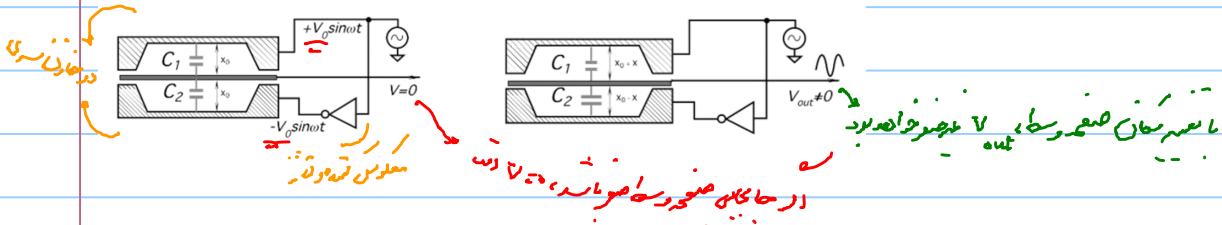
$$C = \frac{K \epsilon_0 b(l-x)}{d} = \alpha + \beta x$$

2) سنسورهای با سوسور مستقیم:

3) سنسورهای با سوسورهای موازی مستقیم:

$$C = C_1 + C_2 = \frac{K_1 \epsilon_0 b x}{d} + \frac{K_2 \epsilon_0 b(l-x)}{d} = \alpha + \beta x$$

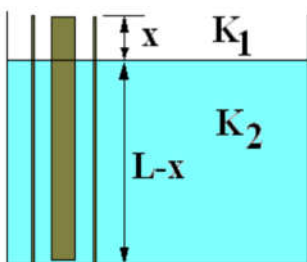
4) سنسورهای با سوسورهای دایره‌ای



5) خازن دستوری:

$L \gg \text{Max}(a, b)$

$$E = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 K L r} \Rightarrow V = \int_a^b E \cdot dr \Rightarrow C = \frac{2\pi \epsilon_0 K L}{\ln(b/a)}$$

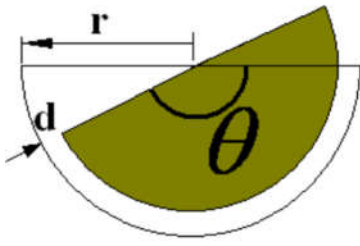


نشان: استفاده از سنسورهای خازنی در اندازه گیری عمق

$$C = \frac{2\pi \epsilon_0 K_2 (l-x)}{\ln(b/a)} + \frac{2\pi \epsilon_0 K_1 x}{\ln(b/a)} = \alpha + \beta x$$

(کاربرد: تنظیم عمق سوسور در مرفه‌ری ها)

م استفاده از خاصیت خاصه جیب افشان می توانیم:

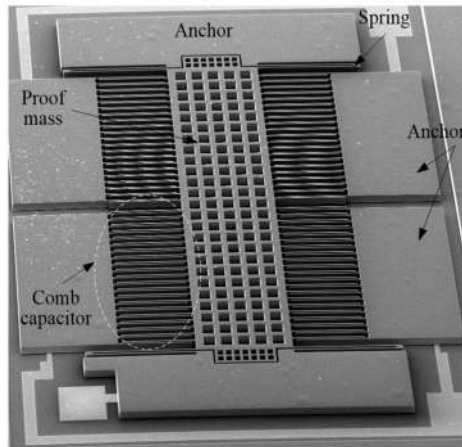


همه در نتیجه به شکل استوار:

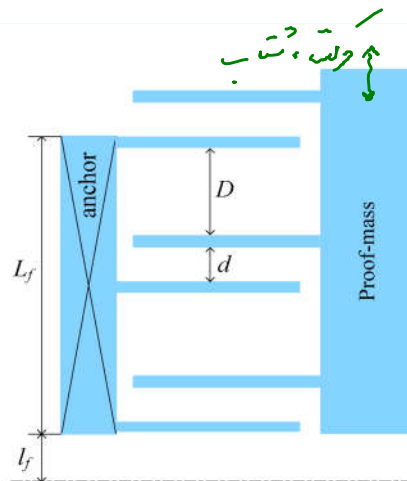
$$C = \frac{2 \epsilon_0 k L}{d} \theta$$

چون حسگرهای خارجی می توانند به عنوان این اشیاء اصل حسگرهای **تغییر فشار**، **تغییر دما** و **تغییر نیرو** بهره ببرند.

نمونه شونده (مثال: شتاب سنج MEMS شتابی)



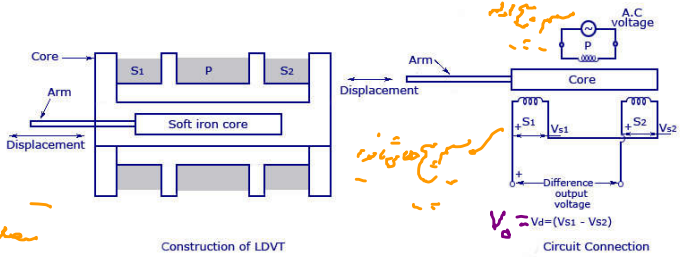
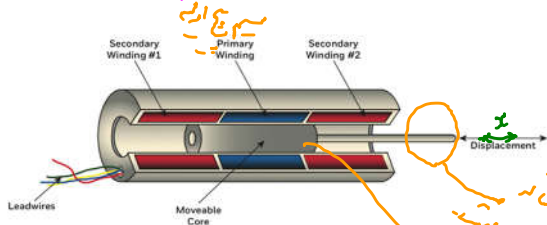
(a)



(b)

الف - 3) سنسورهای القایی - مورد نیاز سنسورهای القایی، تراشه‌های تفاضلی با تغییر حالت (LVDT) برآیند

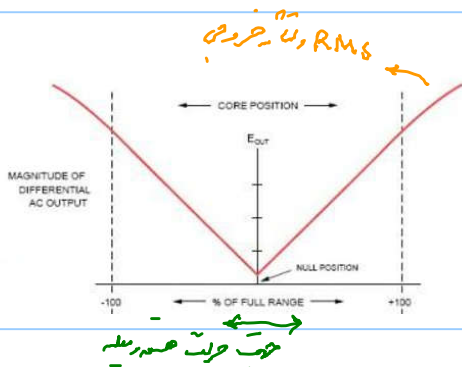
اساس کار: تغییر القایی شار مغناطیسی



Construction and Circuit Connection of LVDT

www.InstrumentationToday.com

حرفه حسنه در وسط قرار بدهد، $V_1 = V_2$ $\Rightarrow V_o = V_1 - V_2 = 0$ ؛ زمانی رفته حرکت ندهد، $V_1 \neq V_2 \Rightarrow V_o \neq 0$

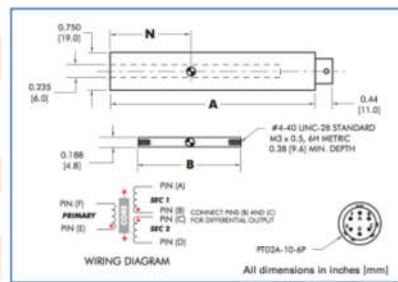


HSTA 750 Series



General Specifications

- Input Voltage: 3.0 V_{rms} (nominal)
- Input Frequency: 2.5 to 3.0 kHz
- Linearity Error: $\pm 0.25\%$ of FRO
- Repeatability Error: <math>< 0.01\%</math> of FSO
- Hysteresis Error: <math>< 0.01\%</math> of FSO
- Operating Temperature: -65°F to +400°F (-55°C to +200°C)
- Thermal Coefficient of Sensitivity: -0.01%/°F (nominal) (-0.02%/°C nominal)
- Vibration Tolerance: 20 g to 2 kHz
- Shock Survival: 1000 g, 11 ms

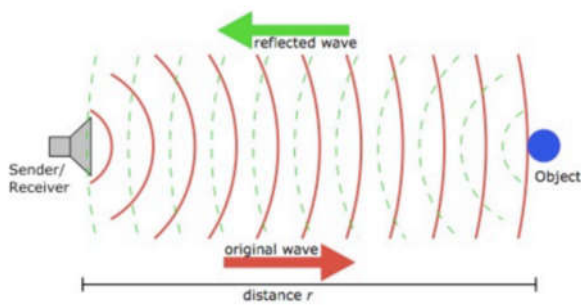


Model	HSTA 750 -050	HSTA 750 -125	HSTA 750 -250	HSTA 750 -500	HSTA 750 -1000	HSTA 750 -2000	HSTA 750 -3000	HSTA 750 -4000	HSTA 750 -5000	HSTA 750 -7500	HSTA 750 -10000
Nominal Range (inches)	±0.050	±0.125	±0.25	±0.50	±1.00	±2.00	±3.00	±4.00	±5.0	±7.50	±10.00
Nominal Range (mm)	±1.3	±3.0	±6.3	±12.5	±25	±50	±75	±100	±125	±190	±250
Sensitivity (mV/V/001 in)	6.1	3.9	2.4	0.63	0.61	0.37	0.25	0.17	0.12	0.11	0.07
Sensitivity (mV/V/mm)	240	154	96	25	24	15	9.8	6.7	4.7	4.3	2.8
Primary Impedance (Ω)	325	735	1400	1200	1250	2150	2150	420	600	775	620
Dimension "A" (inches)	2.01	2.64	3.35	5.92	7.38	10.91	13.65	16.17	18.65	23.85	31.66
Dimension "A" (mm)	51.1	67.1	85.1	150.4	187.5	277.1	346.1	411	473.7	606	804
Dimension "B" (inches)	0.80	1.25	1.65	3.45	3.45	5.30	6.20	6.20	6.20	7.00	9.50
Dimension "B" (mm)	20.3	31.7	41.9	87.6	87.6	134.6	157.5	157.5	157.5	177.8	241.3
Dimension "N" (inches)	0.63	0.94	1.32	2.57	3.32	5.07	6.29	7.65	8.94	11.52	15.42
Dimension "N" (mm)	16	24	33	65	84	129	160	194	227	293	392
Weight - Body (ounces)	1.6	2.1	2.5	3.3	4.3	6.2	8.2	9.2	10.0	14.2	18.3
Weight - Body (g)	45	59	71	93	122	176	232	260	283	402	519
Weight - Core (ounces)	0.08	0.12	0.18	0.40	0.40	0.65	0.80	0.80	0.80	0.90	1.20
Weight - Core (g)	2.4	3.7	4.8	11.6	11.6	18	22	22	22	25.5	34

از جمله مزایای این سنسورها، کاربرد در صنایع مختلف، طولانی بودن عمر آنها، پاسخ دینامیکی سریع، رزولوشن بسیار بالا (تا دقت نانو متر)

در خروجی مطبق می‌باشد. (کاربرد در فشار سنج بردن، مانیتور کردن آبرفت در دامنه‌های مختلف)

الف - 4) سنسورهای التراسونیک (ما فوق صوت)

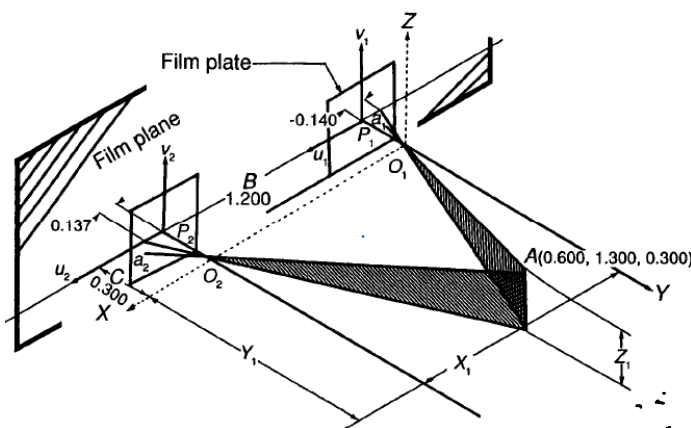


سه اصول حاکم: اثر داپلر و اختلاف زمان حرکت های ارسال و دریافتی.

در این سنسورها موج ما فوق صوت (در حدود 40 KHz) توسط فرستنده ارسال شده و پس از برخورد به هدف (مثبت یا منفی)

که توسط گیرنده دریافت می شود. با اندازه گیری زمان ارسال و دریافتی، فاصله سنسور از مانع قابل محاسبه است.

الف - 5) سیستم های اندازه گیری تصویری



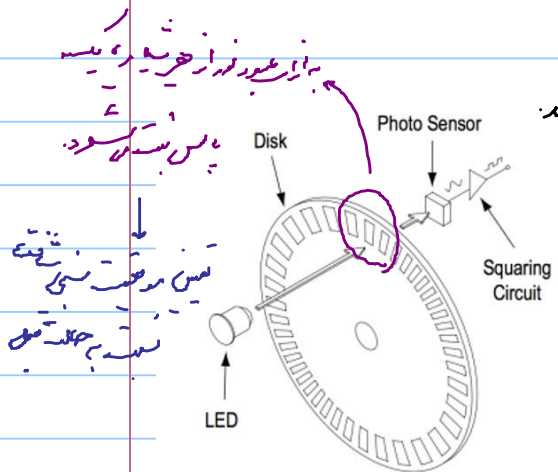
سیستم های از طریق دو دوربین یا فاصله های کانونی و مکان های مشخص

معرف حاکم: نور خفیه، هندسه و زمان

مزایا: بیان دید مناسب، بدون تماس و عدم نیاز به اتصال هوشمند (به فاصله سنسور و مانع)

دقت کم نسبت به سیستم های از طریق لیزر

الف - 6) انکودرهای دیجیتال (Digital Optical Encoders)



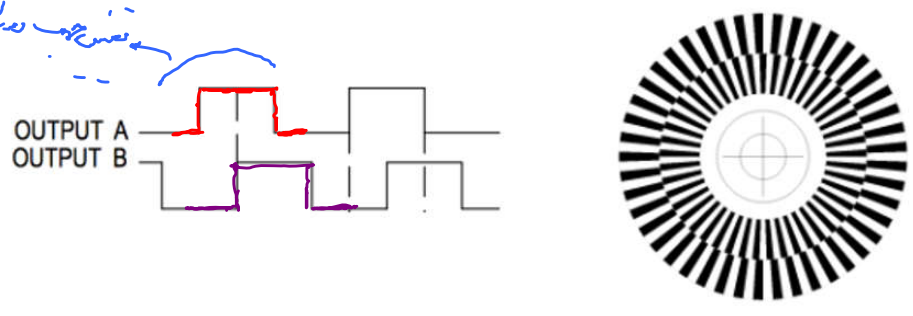
به این سنسورها، جهت (مغزنی یا دوری) را بر حسب اندازه از پالس‌های دیجیتال مدعی می‌کنند

موقعیت یا این انکودرهای دیجیتال می‌تواند به صورت نسبی (Incremental) یا مطلق (Absolute) باشد.

در مطلق (Absolute) باشد.

استاندارد جهانی از دو مجموعه پالس (مثال A و B) با اختلاف فاز نسبت به هم می‌باشد جهت تشخیص سرعت می‌تواند.

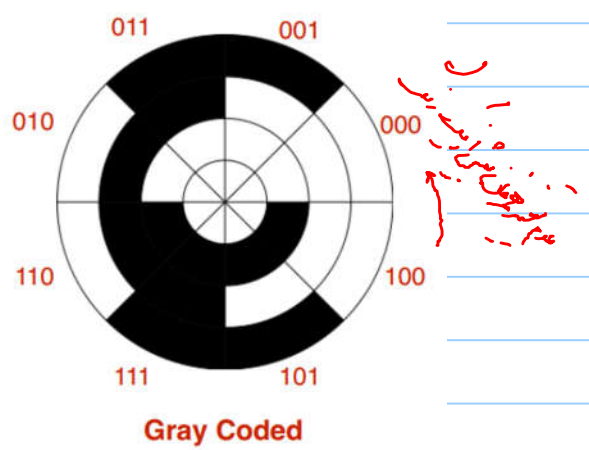
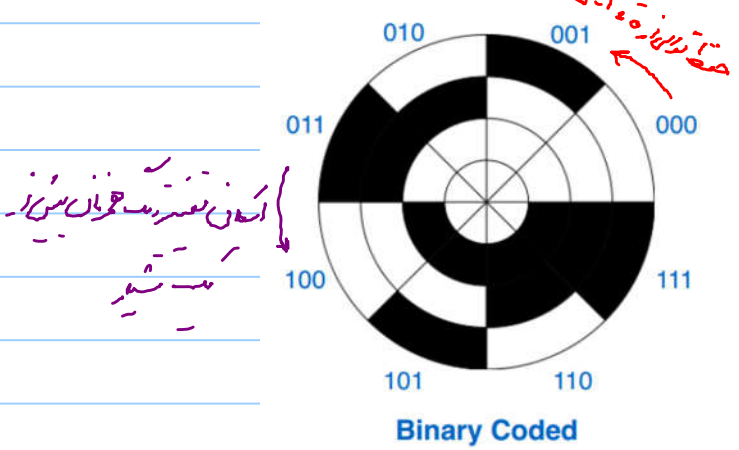
نقص در سرعت نسبی
نقص در چرخش
مثال A و B



انکودرهای Absolute: دارای تعدادی سیر Track بر روی دیسک جهت اندازه‌گیری موقعیت مطلق می‌باشد.

(میدانند با هر سیر دارای زاویه $\frac{360^\circ}{2^n}$ می‌باشد.)

بر روی این انکودرهای دیجیتال (Binary) در حالت سری (Gray) در کلاس موقعیت:



Binary Coded

Gray Coded

1- کرنش سنج (Strain Gauge) (اندازه گیری نیرو، تغییر، فشار و...)

بعضی اوقات در سازه ها و اجزای ماشین ها که تحت تنش و تغییر شکل قرار می گیرند، برای اندازه گیری تغییرات طولی و عرضی آن ها، از کرنش سنج ها استفاده می کنند.

تغییرات طولی و عرضی کرنش سنج را می توان به روش های مختلفی اندازه گیری کرد.

1- کرنش سنج، با تغییر طول (تغییر در طول)، تغییرات (تغییر در طول) و تغییرات (تغییر در طول) در طول سازه را اندازه گیری می کند.

2- کرنش سنج، با تغییرات (تغییرات در طول) در طول سازه، تغییرات (تغییرات در طول) در طول سازه را اندازه گیری می کند.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

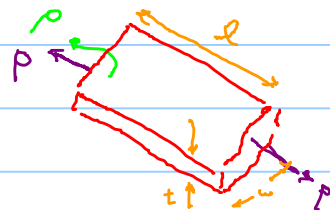
طول سازه l
 سطح مقطع A
 مقاومت ویژه (Resistivity) ρ

اگر یک سازه تحت تنش قرار گیرد، تغییرات طولی و عرضی آن را می توان به روش های مختلفی اندازه گیری کرد.

تغییرات (تغییرات در طول) در طول سازه، تغییرات (تغییرات در طول) در طول سازه را اندازه گیری می کند.

$$R = \rho \frac{l}{A} \Rightarrow dR = \left(\frac{\partial R}{\partial l}\right) dl + \left(\frac{\partial R}{\partial A}\right) dA + \left(\frac{\partial R}{\partial \rho}\right) d\rho$$

$$\Rightarrow dR = \frac{\rho}{A} dl - \frac{\rho l}{A^2} dA + \frac{l}{A} d\rho$$



$$\frac{dR}{R} = \frac{dl}{l} - \frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho}$$

تغییرات کرنش طولی $\frac{dl}{l}$
 تغییرات کرنش عرضی $-\frac{dA}{A}$
 تغییرات مقاومت ویژه $\frac{d\rho}{\rho}$

$$* A = wt \Rightarrow \frac{dA}{A} = \frac{dw}{w} + \frac{dt}{t} = \epsilon_t + \epsilon_t = 2\epsilon_t = -2\nu \epsilon_l$$

تغییرات کرنش عرضی $(-\nu \epsilon_l)$

(piezoresistive effect)

$$\Rightarrow \frac{dR}{R} = (1 + 2\nu) \frac{dl}{l} + \frac{d\rho}{\rho}$$

تغییرات کرنش : Gauge Factor : $G.F = \frac{dR}{R} = \frac{\Delta R}{R_0} = (1 + 2\nu) + \frac{1}{\epsilon_l} \frac{d\rho}{\rho}$

Gauge Factor معروف به حساسیت است. در سنسورهای طولی، تغییر در طول باعث تغییر در مقاومت می شود. $\Delta R/R = G.F. \cdot \epsilon$

در سنسورهای طولی، تغییر در طول باعث تغییر در مقاومت می شود. $\Delta R/R = G.F. \cdot \epsilon$

G.F. برای این سنسورهای طولی در محدوده 2-4.5 و برای فیبرهای نوری بسیار بالاتر (100+) را داراست.

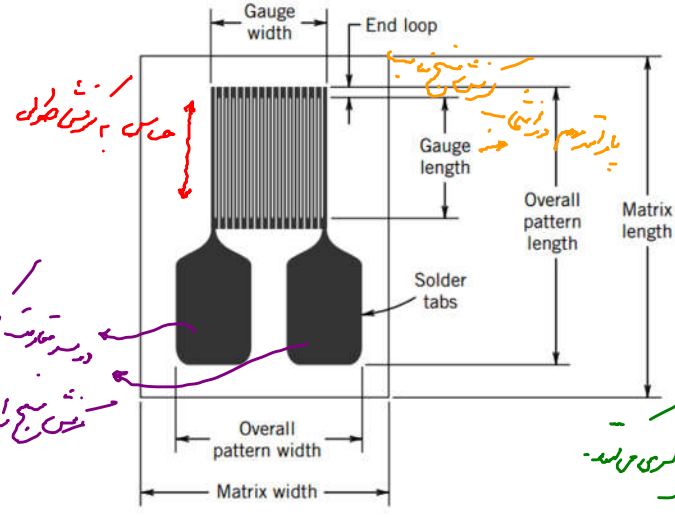
$\rho = 49 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ و $\frac{1}{\epsilon} = 2 \times 10^{-5}$ (یعنی با افزایش دما، تغییر در طول باعث تغییر در مقاومت می شود)

Strain Gauge	Composition	Gauge Factor (λ)
Constantan (Advance)	55% cu, 45% Ni	2
Isoelastic1	36% Ni, 8% Cr, 4% Mn, Si, Molybdenum, 52% Fe	3.5
Isoelastic2	36% Ni, 8% Cr, 0.5% Molybdenum, 55.5% Fe	3.6
Armour D	70% Fe, 20% Cr, 10% Al	2
Platinum-Tungsten	92% Pt, 8% W	4
Nichrome V	80% Ni, 20% Cr	2.1
Semiconductor Strain Gauge		130

PARAMETER	METAL STRAIN GAGE	SEMICONDUCTOR STRAIN GAGE
Measurement Range	0.1 to 40,000 $\mu\epsilon$ ($\epsilon < 4\%$)	0.001 to 3000 $\mu\epsilon$
Gage Factor	2.0 to 4.5	50 to 200
Resistance, (Ω)	120, 350, 600, ..., 5000	1000 to 5000
Resistance Tolerance	0.1% to 0.2%	1% to 2%
Size, mm	0.4 to 150 Standard: 3 to 6	1 to 5

که کاربرد این سنسورهای نیمه رسانا در ساخت سنسورهای فشار و دما (15 تا 80mm) است.

حساسیت به تغییر در طول



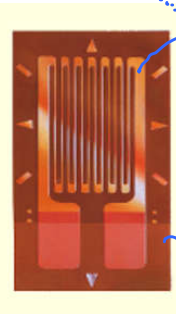
در سنسورهای طولی، تغییر در طول باعث تغییر در مقاومت می شود. این تغییر در طول در اثر نیروی وارده در طول میسر می شود.

نوع دیگر از سنسورها، سنسورهای دما هستند که در اثر تغییر در طول میسر می شود.

این سنسورها، فقط در طولی (طولی) استفاده می کنند.

استفاده از الیاف نوری در سنسورهای طولی، در اثر تغییر در طول میسر می شود.

$L \uparrow \rightarrow R \uparrow \rightarrow \Delta R \uparrow$



این سنسورها، فقط در طولی (طولی) استفاده می کنند. Career matrix (Backing)

حساسیت به تغییر در طول

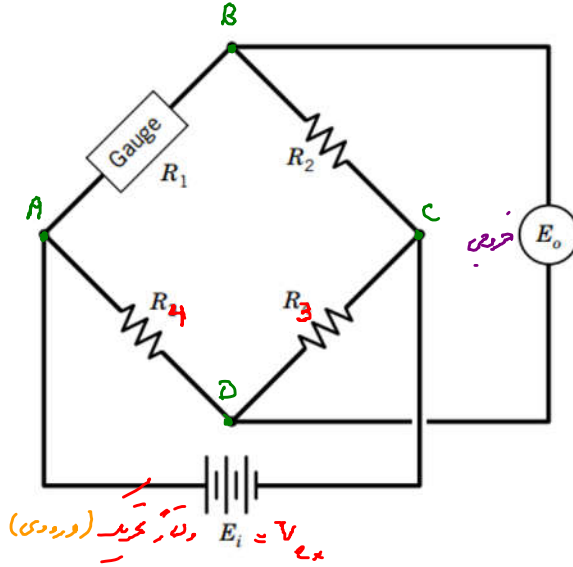
Coranic-Based Cement, Cellulose Nitrate Cement, Epoxies

(Glass reinforced Phenolic polyimide)

* میں سادہ ڈسٹون (Wheatstone Bridge)

تعمیرات عموماً درج ذیل صورت میں ہوتی ہیں۔ یہ سادہ ڈسٹون کے لیے ہے۔

(نیزجیوں کی مثال: " $R_1 R_3$ "، " $R_2 R_4$ ")



$$V_{AB} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E_i$$

$$V_{AD} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} E_i$$

$$V_0 = V_{BD} = V_{AB} - V_{AD} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) E_i$$

$$\Rightarrow E_0 = V_0 = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} E_i$$

$\rightarrow V_0 = 0$ (میل ڈسٹون) $= \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = 0 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3} = r$

بہتر مثال کے لیے $R = R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ لیا جاتا ہے۔

اگرچہ سادگی میں بہتر مثال کے ساتھ ΔR_i کے لیے درج ذیل صورتوں سے $V_0 = 0$ ہوتی ہے۔

$$\Delta V_0 = \left(\frac{(R_1 + \Delta R_1)}{(R_1 + \Delta R_1) + (R_2 + \Delta R_2)} - \frac{(R_4 + \Delta R_4)}{(R_3 + \Delta R_3) + (R_4 + \Delta R_4)} \right) E_i$$

درج ذیل صورتوں کے ساتھ ΔR_i کے لیے درج ذیل صورتوں سے ΔV_0 کے لیے:

$$\Delta V_0 \approx \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)^2} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) E_i$$

$$\frac{R_1}{R_2} = r \Rightarrow \Delta V_0 = \frac{r}{(1+r)^2} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) E_i$$

فرض $\frac{\Delta R_i}{R_i} \ll 1 \rightarrow \Delta E_0 = \sum_{i=1}^4 \frac{\partial E_0}{\partial R_i} \Delta R_i$

نسب $S = \frac{\Delta V_0 / V_{in}}{\Delta R / R} = \frac{\Delta V_0}{V_{in}} \frac{R}{\Delta R}$ (فرض $R_1, R_4 = R$)

- در صورت بهره گیری از دو ریش سنج (Half Bridge) حساسیت کم به صورت زیر است (حواص) / برای چهار ریش سنج حساسیت فاکتور خواهد شد!

پاردهای مجاور فعال دینال (نظر برده 1، 2، 3، 4) (Active Adjacent Arms)

پاردهای متقابل فعال دینال (1، 2، 3، 4) (Active Opposite Arms)

در ΔR هم علامت

$$S = 0$$

$$S = \frac{1}{2}$$

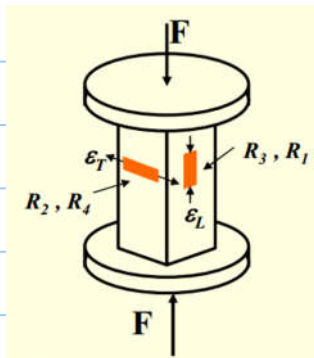
در ΔR غیر هم علامت

$$S = \frac{1}{2}$$

$$S = 0$$

نمایش از هدف جمع کردن غیر هم علامت ها را تو این حساسیت کم است: باید پاردهای هم علامت و غیر هم علامت ها فرم علامت

ب (1) اندازه گیری نیرو توسط لودسل های ستون (pillar load cells)



$$\epsilon_{R_1} = \epsilon_{R_3} = \frac{F}{AE} = \epsilon_L \quad (\text{دو ریش سنج هم علامت})$$

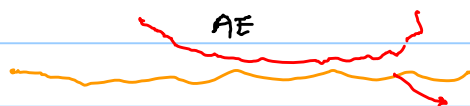
$$\epsilon_{R_2} = \epsilon_{R_4} = -\nu \frac{F}{AE} = -\nu \epsilon_L$$

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta R_3}{R_3} = (G.F.) \epsilon_L$$

$$\frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{\Delta R_4}{R_4} = (G.F.) \epsilon_t = -\nu (G.F.) \epsilon_L$$

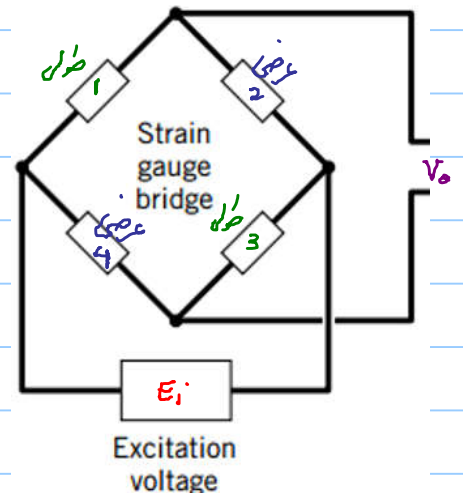
$$\Delta V_o = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) E_i$$

$$\Rightarrow \Delta V_o = \frac{1}{2} \frac{(1+\nu)(G.F.) E_i}{AE} F$$



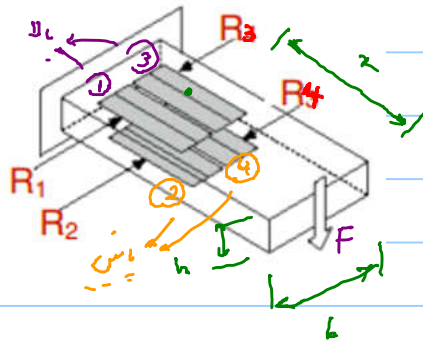
حساسیت سنسور (S)

$A \downarrow \Rightarrow$ با ظرفیت کمتر و \uparrow حساسیت S
 $A \uparrow \Rightarrow$ \uparrow ظرفیت سنسور با حساسیت S



* این ریش سنج از ریش سنج ها، اثرات ریش سنج ها (به عنوان فرودین، مطلوب) را حذف می کند

2- حساسیت سول سترین (نسبت نیروی بر سر واحد طول)

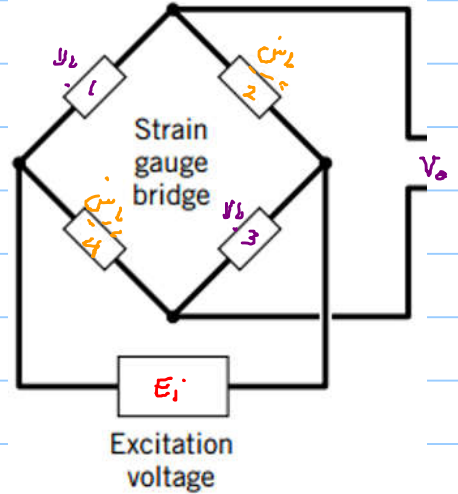


$$\epsilon_1 = -\epsilon_2 = \epsilon_3 = -\epsilon_4 = \frac{(Fx) \frac{h}{2}}{\left(\frac{1}{12}bh^3\right)E} = \frac{6Fx}{Ebh^2}$$

$$\frac{\Delta R_i}{R_i} = (G.F.) \epsilon_i$$

$$\Rightarrow E_o = \frac{6x \cdot (G.F.) \epsilon_i}{Ebh^2} F \Rightarrow E_o = S F$$

حساسیت سول سترین (the load) بر سر واحد

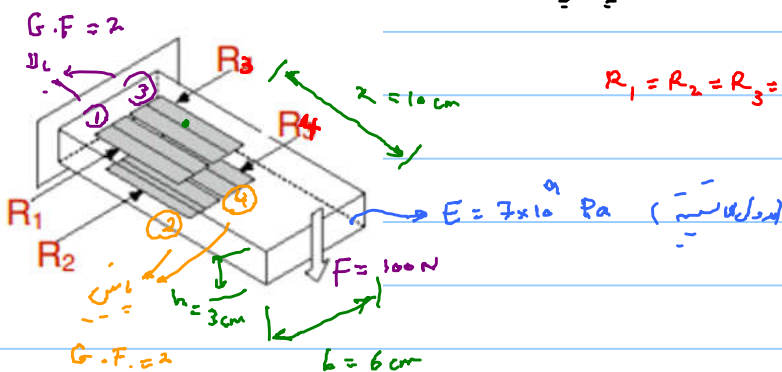


این ولتج، در انتهای نشانی از نیروهای شکری در آن است

سؤال: چهار سول سترین روی یک سازه برقرار شده است. به اینها این نیروی F وارد شده است

با توجه به اطلاعات جدول این سازه (سازه) سازه خود را این سازه را محاسبه کنید. با این ولتج ورودی

این سازه از این چهار سول سترین، 12V باشد و ولتج خروجی آن چقدر است؟



$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 120 \Omega$$

سول سترین یکسان نیرو

$$E = 7 \times 10^9 \text{ Pa (مدول الاستیسیته)}$$

$$\epsilon_1 = -\epsilon_2 = \epsilon_3 = -\epsilon_4 = \frac{\sigma}{E} = \frac{Mx}{EI} = \frac{6(Fx)}{Ebh^2} = \frac{6 \times 100 \times 0.1}{7 \times 10^9 \times 0.06 \times 0.03^2} = 1.6 \times 10^{-4}$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} = G.F. \cdot \epsilon \Rightarrow \Delta R = R_0 \cdot (G.F.) \cdot \epsilon$$

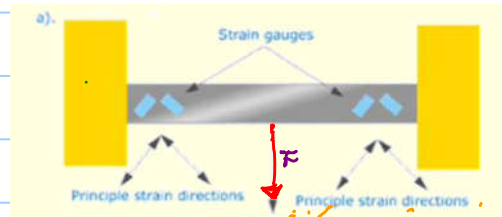
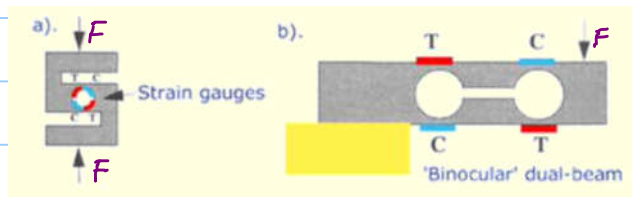
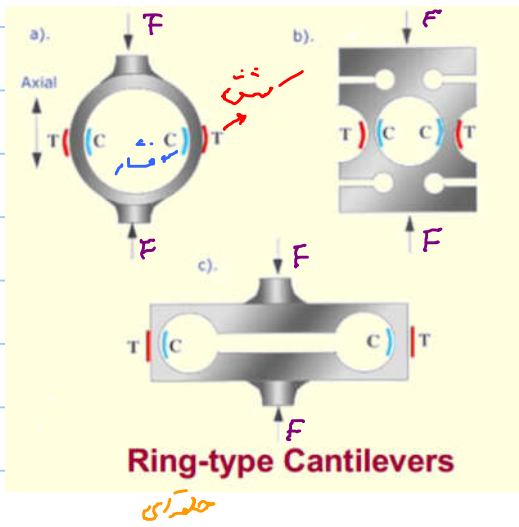
بر حورس سنج، تغییر مقاومت عبارت است از:

$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = R_3 = R_0 (1 + (G.F.) \cdot \epsilon) \Rightarrow R_1 = R_3 = 120.038 \Omega \\ R_2 = R_4 = R_0 (1 - (G.F.) \cdot \epsilon) \Rightarrow R_2 = R_4 = 119.962 \Omega \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_0 = \left(\frac{R_0 (1 + (G.F.) \cdot \epsilon)}{R_0 (1 + G.F. \cdot \epsilon) + R_0 (1 - G.F. \cdot \epsilon)} - \frac{R_0 (1 - (G.F.) \cdot \epsilon)}{R_0 (1 + G.F. \cdot \epsilon) + R_0 (1 - G.F. \cdot \epsilon)} \right) E_i$$

$$\Rightarrow V_0 = \left(\frac{1 + G.F. \cdot \epsilon}{2} - \frac{1 - G.F. \cdot \epsilon}{2} \right) E_i \Rightarrow V_0 = 2 \times 1.6 \times 10^{-4} \times 12 = 0.00387$$

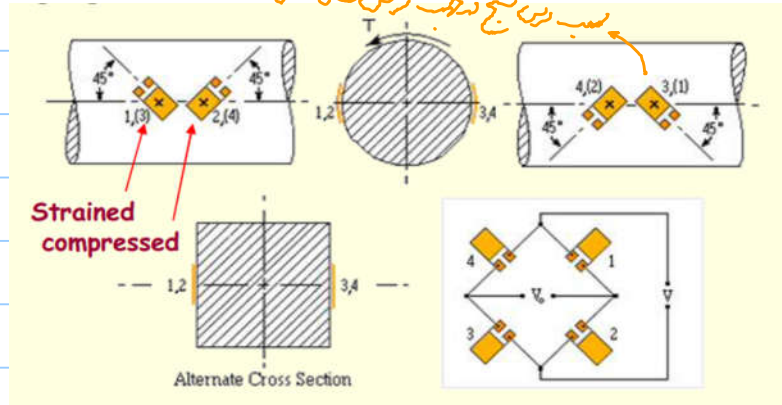
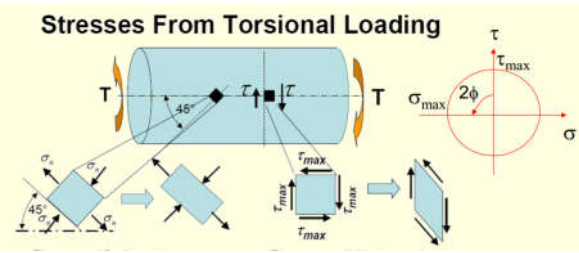
- لودسل‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: سیمی، ورقه‌ای و سرامیکی:



انصال کرنش سنج در محبت های اصل کرنش

تورق خلیوں کے لیے (Torque Cells)

تورق خلیوں کی دو جڑیں ہوتی ہیں



$$\tau_{xy} = \frac{T r}{J} = \frac{16 T}{\pi D^3} \cdot \frac{\pi D^4}{32}$$

$$\sigma_1 = -\sigma_2 = \tau_{max} = \frac{16 T}{\pi D^3}$$

تورق خلیوں کی دو جڑیں ہوتی ہیں

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E} (\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)) \Rightarrow \epsilon_1 = \frac{16 T}{\pi D^3} \left(\frac{1+\nu}{E} \right)$$

$$\epsilon_2 = \frac{1}{E} (\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)) \Rightarrow \epsilon_2 = \frac{-16 T}{\pi D^3} \left(\frac{1+\nu}{E} \right)$$

$$\rightarrow V_o = \frac{16}{\pi D^3} \left(\frac{1+\nu}{E} \right) \cdot (G.F.) \cdot E_i \cdot T$$

حالت 5

